

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日

2006年8月31日 (31.08.2006)

PCT

(10) 国際公開番号

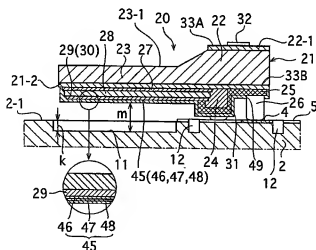
WO 2006/090805 A1

- (51) 国際特許分類:  
G01C 19/56 (2006.01) G01P 9/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/303330
- (22) 国際出願日: 2006年2月23日 (23.02.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2005-047802 2005年2月23日 (23.02.2005) JP  
特願 2005-050962 2005年2月25日 (25.02.2005) JP  
特願 2005-066051 2005年3月9日 (09.03.2005) JP  
特願 2005-374325 2005年12月27日 (27.12.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国については: ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 Tokyo (JP)).
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡邊 成人 (WATANABE, Shigetou), 本多 順一 (HONDA, Junichi), 佐々木 伸 (SASAKI, Shin), 高橋 和夫 (TAKAHASHI, Kazuo), 稲熊 輝往 (INAGUMA, Teruo), 鈴木 浩二 (SUZUKI, Koji), 相澤 学 (AIZAWA, Manabu).
- (74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 8 号 虎ノ門 平塔タワー 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU,

[続葉有]

(54) Title: OSCILLATORY GYRO SENSOR

(54) 発明の名称: 振動型ジャイロセンサ



(57) Abstract: An oscillatory gyro sensor in which the size is reduced and a high Q value is through a simple arrangement. The oscillatory gyro sensor (1) comprises a supporting substrate (2) on which a circuit element is mounted and a wiring pattern having a plurality of lands (4) is formed and an oscillatory element (20) mounted on the surface (2-1) of the supporting substrate. The oscillatory element (20) includes a base portion (22) having a mounting surface (22-2) on which a plurality of terminals (25) connected with the lands are formed and an oscillator (23) having a surface opposed to the substrate on which a first electrode layer (27) protruding integrally in a cantilever form from the side periphery of the base portion (22) and having a surface flush with the mounting surface of the base portion (22), a piezoelectric layer (28) formed on the first electrode layer and second electrode layers (29, 30) are formed. The oscillatory element (20) is mounted on the supporting substrate (2) by joining each terminal (25) to the land (4) through a metal protrusion (26).

(57) 要約: 簡易な構成によって小型化と高Q値を得ることで特性の向上を図る。本発明の振動型ジャイロセンサ 1 は、回路素子が実装されるとともに複数個のランド 4 を有する配線パターンが形成された支持基板 2 と、この支持基板の表面 2-1 に実装された振動素子 20 とを備え、振動素子 20 は、上記ラ

[続葉有]